

Erratum: Femtosecond-Laser Micromachining of a Thermal Blocking Trench for an Enhanced PLC Variable Optical Attenuator

Dongyoon Yoo¹, Hun-Kook Choi¹, Ik-Bu Sohn^{1†}, Youngsic Kim^{2,3}, Suyong Kim^{2,3},
Wanchun Kim^{2,3}, and Jinbong Kim^{2,3}

¹Advanced Photonics Research Institute, Gwangju Institute of Science and Technology, Gwangju 61005, Korea

²Interdisciplinary Program for Photonic Engineering, Chonnam national university, Gwangju 61186, Korea

³Photonics Planar Integration Inc., Gwangju 61008, Korea

(Received May 12, 2016; Revised manuscript August 2, 2016; Accepted August 4, 2016)

※ 2016년 8월호(27권 4호)에 발표된 ‘펨토초 레이저를 이용한 PLC 가변광감쇠기 특성 향상을 위한 열간섭 차단 트렌치 가공 기술’ 논문 중 131페이지 그림 7을 다음의 그림으로 수정합니다.

